

Datum: 17.03.09
Anlage: 2 jpgs.
Kennziffer: PR-0030-FKAP-170309-MEMS

Polytec präsentiert Innovationen der optischen Messtechnik für MEMS/MST auf der Hannover Messe 2009

Auf der Sondershow MicroTechnology 2009 präsentiert Polytec im Rahmen der Hannover Messe Lösungen der optischen Messtechnik zur Charakterisierung des dynamischen Verhaltens sowie auch zur Messung der statischen Topographie von Mikrosystemen.

2 Größenordnungen mehr Bandbreite gegenüber herkömmlichen Vibrometern prädestinieren das brandneue Polytec UHF-120 Ultra-Hoch Frequenz Vibrometer zur Messung mechanischer Schwingungen im Bereich bis zu einigen Hundert MHz und ermöglicht so ein Bündel neuartiger Anwendungen.

Für die allgemeine dynamische 3-D Charakterisierung und auch zur Analyse der Oberflächentopografie von MEMS- und MOEMS-Mikrostrukturen ist der Polytec MSA-500 Micro System Analyzer das Instrument der Wahl. Als funktionsstarkes All-in-one Messsystem ermöglicht es schnelle und aussagekräftige Messungen wichtiger funktionaler Größen von Mikrosystemen.

Und für Anwendungen der Qualitätskontrolle zeigt Polytec das TMS-100 TopMap Metro.Lab zur großflächigen Messung der Oberflächentopographie. Das schnelle, optische System verfügt über ein großes Gesichtsfeld bei gleichzeitig großem Scanbereich von bis zu 70 mm.

Zusätzlich zur Messgerätepräsentation auf dem IVAM-Gemeinschaftsstand ist Polytec mit dem Fachvortrag „Optical Characterization of Dynamic and Topography Properties of Microsystems“ auf dem IVAM-Forum vertreten.

Weitere Informationen: www.polytec.com

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel. 07243-604-236